

超高压電子顕微鏡施設 利用料金表

2018年4月1日

I 機器利用料(1時間あたり)(単位:円)

| | 機器等名称 | 学内者 | 学外者 | |
|----|---|-------|-------|--------|
| | | | 非営利法人 | 営利法人 |
| 1 | 反応科学超高压走査透過電子顕微鏡システム JEM-1000K RS | 2,600 | 3,500 | 10,300 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 4,200 | 12,500 |
| 2 | 高電圧用収差補正開発試験装置(収差補正電子顕微鏡) EM-10000BU | 1,100 | 1,500 | 5,100 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 1,800 | 6,200 |
| 3 | 高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム(収差補正電子顕微鏡) JEM-ARM200F Cold | 1,100 | 1,500 | 4,900 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 1,800 | 5,900 |
| 4 | 高分解能透過型電子顕微鏡システム JEM-2100F/HK | 700 | 1,000 | 4,200 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 1,200 | 5,100 |
| 5 | 透過電子顕微鏡システム JEM-2100 Plus | 600 | 1,000 | 2,600 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 1,300 | 3,100 |
| 6 | 環境実験用観察装置 MP-66100(走査電子顕微鏡) JSM-6610A | 400 | 600 | 2,200 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 700 | 2,700 |
| 7 | 直交配置型高速加工観察分析装置(FIB-SEM) MI4000L | 1,600 | 2,200 | 5,300 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 2,700 | 6,400 |
| 8 | 集束イオンビーム加工機(FIB) FB-2100 | 1,200 | 1,700 | 3,800 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 2,100 | 4,600 |
| 9 | イオンビーム試料作製装置(FIB) JEM-9320NT | 800 | 1,100 | 2,500 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 1,300 | 3,000 |
| 10 | アルゴンイオン照射試料作成装置 クロスセクションポリッシャー | 200 | 400 | 800 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 500 | 1,000 |
| 11 | 金属イオン照射試料作成装置 PIPS-II | 200 | 400 | 700 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 500 | 800 |
| 12 | クライオミクローム | 200 | 400 | 600 |
| | (オプション)研究成果非公開使用料 | --- | 500 | 700 |

- 1 基本使用料は機器利用1時間あたりの利用料です。
- 2 非公開使用料は、機器利用1時間あたりのオプション料金であり、基本料金に別途加算します。
- 3 利用料金には消費税が含まれています。

II 解析手数料(単位:円)

| | |
|--------|-------|
| 1時間当たり | 6,500 |
|--------|-------|

III コンサルティング料(単位:円)

| | |
|-------------|---------|
| 3時間未満 | 65,000 |
| 3時間以上～6時間未満 | 162,500 |
| 6時間以上～8時間 | 260,000 |